

# DE-6UH II

封装基板用 高精度直描式曝光机

超群的技术 — 同时实现高解像度与生产率

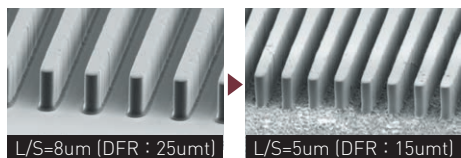


# DE-6UH II 封装基板用 高精直描式曝光机

## 引领次代线路成形、引人注目的直描式曝光机

### □解析度和生产性的并立显示出、证明了超群的技术实力・高精度

为应对更精细的回路制造需求、我们不停的改进已有的直描光学系统光学系技术、实现了加工点直径的微细化。达成业界最高的L/S=8um、并继续研发出L/S=5um的解像度。



新机的扫描速度比以往机型提高1.4倍、大幅度地提高了生产效率。同时、达成描画精度 | AVE | +3σ < 7um

### □以业界顶级的技术实力为生产性提升做出飞跃贡献

DE-6UH II E 灵活对应多种模式。多区域的实时补正、搭载预对位相机的高精度移动轴、使每张基板的处理效率得以改进、为生产性的提升做出了飞跃的贡献。

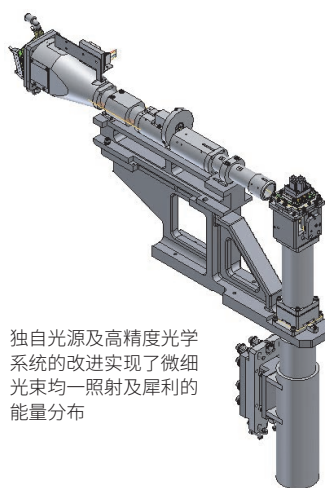
另外、由JOB viewer专注于生成作业可视化和条件生成自动化、在线控制系统让产品在线统一管理得以容易实现、并提供内容丰富的各种选项。

### □智能化高品质维护性能

DE-6UH II E 配备了激光输出的跟踪监视和修正功能、光轴间装备了自动监视系统、追求智能化高品质的维护。

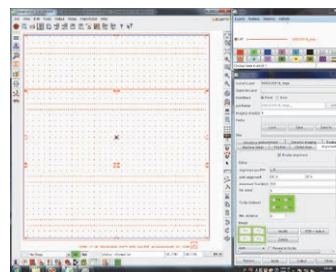
另外本体的小型化设计使得与胶片曝光机的调换更为容易。

### 高精度光源机组



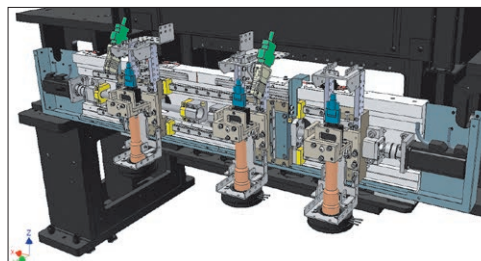
独自光源及高精度光学系统的改进实现了微细光束均一照射及犀利的能量分布

### JOB Viewer操作画面



各种描画数据可以瞬间得到确认、实现了快捷方便的操作环境

### 装配对位用摄像机的精度高移动轴

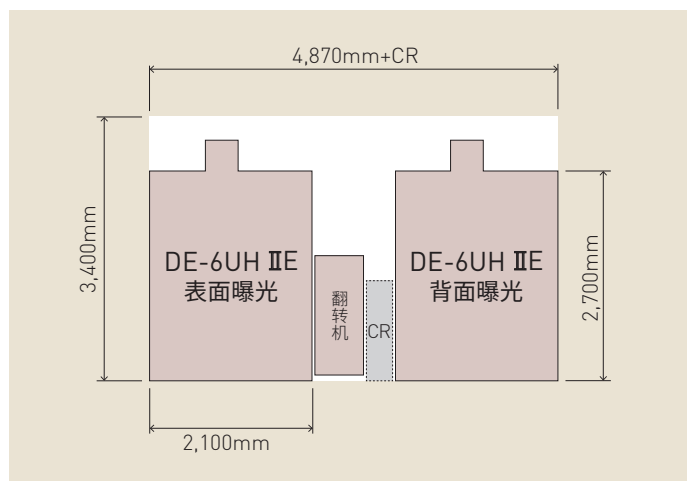


不依赖于对位点的位置、使分割描画时对齐处理时间得到缩短

### DE-6UH II E / 主要规格

项目	内容
最大扫描范围	610×510mm
最小线宽线距 (L/S)	8/8um
加工速度	90张/时 (80mJ/cm <sup>2</sup> , 405×510mm)
对位精度	AVE   +3σ < 7um (our standard)
光源	镭射二极管 405nm
曝光方式	DMD
工件固定方式	真空桌面+机械式夹具
扫描区域分割	2-16个
数控装置	MARK-50E

### 设置面积



维亚机械株式会社 Via Mechanics, Ltd.

总公司地址：日本海老名市上今泉2100 邮编：243-0488

电话：+81-46-235-9354 传真：+81-46-235-9356

http://www.viamechanics.com/



ISO9001:2008 認証取得  
ISO14001:2004 認証取得